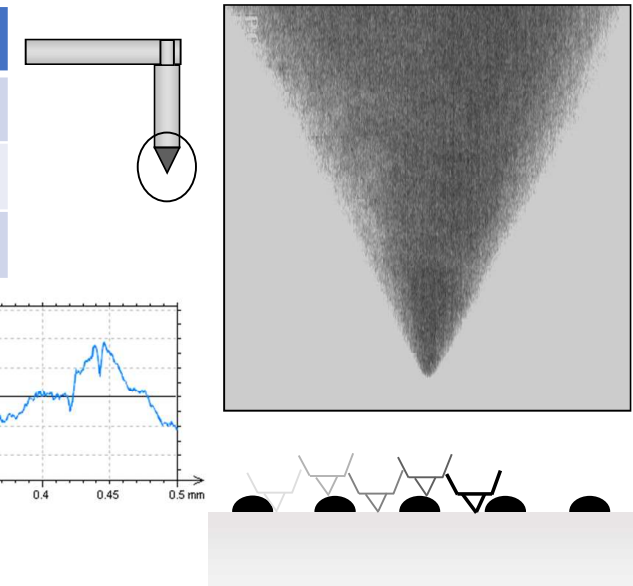
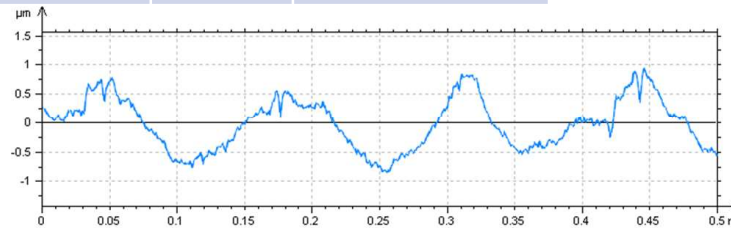


## Стилусный профилометр KLA D-500 (США)



	Разр. X	Разр. Y	Разр. Z	Макс. область
АСМ	<1 нм	<1 нм	0.1 нм	<120 мкм
СЭМ	<1 нм	<1 нм	-	любая
Профилометр	200 нм	<5 мкм	<1 нм	миллиметры



### Применения профилометрии:

- Определение шероховатости, высоты ступеней
- Информация о топографии поверхности, дефектах
- Информация о напряжении в пластинах

Разрешение по X ограничено размером острия стилуса: **200 нм**

Разрешение по Y ограничено точностью перемещения столика: **1 мкм**

Разрешение по Z: уровень шумов среды, обычно около **0.1 нм**

Контактное лицо – Александр Гулин.

### Методы исследования топографии материалов:

- Атомно-силовая микроскопия
- Растровая (сканирующая) электронная микроскопия
- Стилусная профилометрия

